

実体 / 培養倒立 / 偏光顕微鏡



実体顕微鏡
SMZ25



実体顕微鏡
SMZ1270



実体顕微鏡
SMZ745T



ECLIPSE
Ts 2



ECLIPSE
Ts 2R



ECLIPSE
LV100ND



顕微鏡デジタルカメラ
DS-Ri2



顕微鏡モノクロデジタルカメラ
DS-Qi2



高精細カメラヘッド DS-Fi2
カメラコントロールユニット DS-L3

工業用顕微鏡

ECLIPSE LV100ND



【主な特長】

- ・半導体デバイス、パッケージ、FPD、電子部品、素材・材料、精密金型など多岐に渡る産業分野向けの用途に合わせ、顕微鏡体をモジュール化。
- ・反射型の明視野／暗視野／微分干渉／蛍光／偏光／二光束干渉観察に加え、透過型の微分干渉／暗視野／偏光／位相差観察にも対応しています。

【主な仕様】

鏡基	ベースレスタイプ 試料最大高さ 38 mm(使用時LVNU5 U5レボ, LV-S32 3×2ステージ・LV-S64 6×4ステージ使用時), 12V50W調光用電源内臓, 一軸粗微動ハンドル 左: 粗微動/ 右: 微動 ストローク 40 mm, 粗動 14 mm/ 1回転(トルク調節・再焦準機構付), 微動 0.1 mm/ 1回転(1 μm/ 目盛)
レボルバー	6孔レボルバー C-N6 ESD, DIC 6孔レボルバー D-ND6
反射照明装置	LV-UEPI-N プリセンターハウス 12V50W LV-LH50PC, 明暗視野の切り替えと連動の開口絞り・視野絞り(心出し可), φ25 mm フィルター(NCB11, ND16, ND4)挿入可, ポラライザー / アナライザー挿入可, ノイズターミネーター搭載
透過照明部	プリセンターハウス 12V50W LV-LH50PC(フライアイ光学系), 開口絞り, 視野絞り, フィルター内蔵(NCB11, ND8), 透過/反射切替スイッチ
対物レンズ	TU Plan ELWD 20x, 50x
接眼レンズ	CFI 10×/22, CFI 10×/22 CM